賛助会員の活動紹介

横河電機株式会社

1. 横河電機のMEMS技術への取組

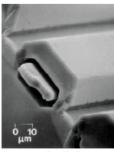
YOKOGAWAのビジネスの基本は、計測・制 御・情報をコア技術として、変革する産業界に 先端マザーツールを提供することです。主な事 業分野は、原油高を背景に海外でのビジネスを 伸ばしている制御事業、半導体テスタ・電子計 測器からなる計測機器事業です。YOKOGAWA は、2005年に創立90周年を迎えましたが、技術 開発本部では、2015年の百周年に向けて、お客 様の課題を解決するためのLeading Edge Technologyを開発しています。その中でも、商品 を差別化するためのキーデバイスを作り出す MEMS技術には力を入れています。YOKOGAWA がMEMS技術の研究を始めてから20年が経ちま すが、多くの基本技術を蓄積してきました。 この蓄積技術を活用し、メインビジネスや新ビ ジネスの種となる新しいデバイスを開発してい ます。

2.研究開発の現状

代表的な商品および開発中のデバイスの例を 紹介します。

(1) Si-振動式センサデバイスの開発

1991年に発売を開始したプロセス用差圧計 Dpharpのキーデバイスは、**図1**に示すSiの微小 振動子です。世界的に見てもMEMS技術を活用 したデバイスとして先駆的な商品であり、世界 中で150万台が稼動するまでになりました。世界 市場でのシェアを伸ばしており、グローバルNo. 1になる日も近いと感じています。横河のメイ ン機種として成長した現在も、基本となるSi振 動子の開発は重要なテーマと位置付け、継続的 に開発を進めております。



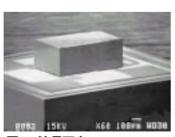


図1 Si-振動式センサ 図2 波長可変MEMS-VCSEL



先端技術研究所長 磯崎 克巳

(2)波長可変MEMS-VCSELの開発

図2のデバイスは、NEDO「高集積・複合 MEMS製造技術開発プロジェクト」の支援を受 けて開発中の波長可変MEMS-VCSELです。横河 が差別化技術として保有するSi-MEMS技術と化 合物半導体技術を融合したユニークなデバイス の実現を目指しています。

(3)マイクロリアクタへの取組

マイクロリアクタとは、化学反応場を微小流路 内に持ち込み、その微小領域の物質を自由に操 る事で、今までに実現できなかったサイズと機 能を持つプラントを実現する技術であり、その 時のキー技術はMEMS技術です。マイクロリア クタの技術は、付加価値の高い機能性材料を少 量生産する医薬品やファインケミカルの製造方法 に革新をもたらす技術と期待されており、重点 テーマと位置付け開発に取組んでいます。 図3 は三井化学様と共同で開発を進めている、オン サイトガス製造用マイクロリアクタチップです。

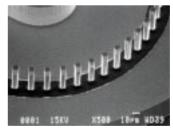


図3 マイクロリアクタデバイス

3.今後の取組

MEMS技術は製造技術です。他の技術との融 合により付加価値を増大させることが重要です。 今後は、化学技術との融合をはかり、マイクロ リアクタ、バイオ、燃料電池への展開を図って いきたいと考えております。

発 行 財団法人マイクロマシンセンター

発行人 青柳 桂一 〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67 MBR99ビル6階 TEL.03-5835-1870 FAX.03-5835-1873 wwwホームページ:http://www.mmc.or.jp/